PLASTIC LIGHT GUIDE WAVE PASSAGE

、此志,为魏武、西汉等国家

Patent number:

JP4157402

Publication date:

1992-05-29

Inventor:

IMAMURA SABURO; IZAWA TATSUO

Applicant:

NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

Classification:

- international:

C08G77/04; G02B6/00; G02B6/12; C08G77/00;

G02B6/00; G02B6/12; (IPC1-7): C08G77/04; G02B6/00;

G02B6/12

- european:

Application number: JP19900282023 19901022 Priority number(s): JP19900282023 19901022

Report a data error here

Abstract of JP4157402

PURPOSE:To easily control refractive index, improve heat resistance and decrease effect of OH vibration absorption along with moisture absorption by making both core section and clad section of polysiloxane. CONSTITUTION:A core section and a clad section are both made of polysiloxane. For this reason, plastic light conductive wave passage of various refractive indexes are obtained, and the refractive index is easily controlled. Since a main chain structure is made of siloxane, a low loss guide wave passage showing high moisture proof can be obtained, and in addition, due to the halogenation of the side chain, the hygroscopicity of polymer is substantially lowered, and O-H vibration dissipation strength based on moisture absorption is extremely decreased. By this constitution, refractive index control, low loss factor, hygroscopicity, etc., can be improved and light properties can be kept stable.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

THIS PAGE BLANK (USPTO)

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-157402

®Int. Cl. 5

識別記号

NUB

庁内整理番号

43公開 平成 4年(1992) 5月29日

G 02 B 6/00 3 9 1

7036-2K 7036-2K

// C 08 G 77/04 6939 - 4 J

審杳請求 請求項の数 8 (全9頁) 未請求

会発明の名称

プラスチック光導波路

②特 頭 平2-282023

eB

22出 願 平2(1990)10月22日

@発 明 者 村 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

日本電信電話株式

会社内

@発 明 達 夫 東京都千代田区内幸町1丁目1番6号 日本電信電話株式

会社内

何出 頭 人

日本電信電話株式会社

東京都千代田区内幸町1丁目1番6号

@代 理 弁理士 谷 義 一

1. 発明の名称

ブラスチック光導波路

- 2. 特許請求の範囲
- 1) ポリマからなるコア部と、該コア部を囲みコ ア部より低い屈折率を有するポリマからなるク ラッド部とを有するプラスチック光導波路におい て、前記コア部およびクラッド部がともにポリシ ロキサンからなることを特徴とするブラスチック 光導波路。
- 2) 前記コア部が下記一般式(1) または(1) で表される化学構造を繰り返し単位として有する ポリシロキサンであることを特徴とする請求項1 に記載のプラスチック光導波路:

ただし、R.およびR.はそれぞれC.Y.n.,(Yは水 素あるいはハロゲン原子、 n は 5 以下の正の整 数)で表されるアルキル基あるいはハロゲン化ア ルキル基またはCoYoで表されるフェニル基または ハロゲン化フェニル基である。

3) 前記コア部が下記一般式(Ⅰ) または(Ⅱ) で表される化学構造のうち2種以上の異なった繰 り返し単位からなる共重合体のポリシロキサンで あることを特徴とする請求項1に記載のブラス チック光導波路:

特開平4-157402(2)

ただし、R.およびR.はそれぞれCnYan・1 (Yは水 素あるいはハロゲン原子、nは5以下の正の整 数)で表されるアルキル基あるいはハロゲン化ア ルキル基またはCaYaで表されるフェニル基または ハロゲン化フェニル基である。

4)前記コア部がそれぞれ下記一般式(I)および (I) で表される化学構造を繰り返し単位として有するシロキサンの共重合体であることを特徴とする請求項1に記載のブラスチック光導液路:

ただし、R,およびR。はそれぞれCoYson(Yは水 素あるいはハロゲン原子、nは5以下の正の整 数)で表されるアルキル基あるいはハロゲン化ア ルキル基またはCoYsで表されるフェニル基または ハロゲン化フェニル基である。

5) 前記クラッド部が下記一般式(I) または (II) で表される化学構造を繰り返し単位として 有するポリシロキサンであることを特徴とする請 求項 1 ないし 4 のいずれかに記載のブラスチック 光導波路:

ただし、R₁およびR₂はそれぞれC_nY₂n·1(Y は水 素あるいはハロゲン原子、n は 5 以下の正の整 数) で表されるアルキル基あるいはハロゲン化ア ルキル基またはC₂Y₂で表されるフェニル基または ハロゲン化フェニル基である。

6)前記クラッド部が下記一般式(I)または (II)で表される化学構造のうち2種以上の異なった繰り返し単位からなる共重合体のポリシロ キサンであることを特徴とする請求項Ⅰないし4 のいずれかに記載のプラスチック光導波路:

ただし、R₁およびR₂はそれぞれC_nY_{2,n+1}(Y は水 素あるいはハロゲン原子、n は 5 以下の正の整 数) で表されるアルキル基あるいはハロゲン化ア ルキル基またはC_nY_nで表されるフェニル基または ハロゲン化フェニル基である。

7)前記クラッド部がそれぞれ下記一般式(I) および(II)で表される化学構造を繰り返し単位 として有するポリシロキサンの共重合体であるこ とを特徴とする請求項1ないし4のいずれかに記 載のプラスチック光導波路:

ただし、R₁およびR₂はそれぞれC_nY_{2n-1}(Yは水 素あるいはハロゲン原子、nは5以下の正の整 数)で表されるアルキル基あるいはハロゲン化ア ルキル基またはC₂Y₂で表されるフェニル基または ハロゲン化フェニル基である。

8) 基板と、

該基板上に順次形成され、それぞれポリマからなる下層クラッド部、コア部、および下層クラッド部と共にコア部を囲む上層クラッド部とを有し、

前記コア部がポリシロキサンからなり、前記下層クラッド部および上層クラッド部がそれぞれ前記コア部より屈折率が低いポリシロキサンからなることを特徴とするプラスチック光導波路。

ファイバは、無機系のファイバに比べて内部を伝達する光の減衰度合が大きいという欠点がある。 光回路部品においては現状の光ファイバ通信に用いられている光の波長が650nm ~1600nmの光を用いていることから、プラスチックを用いる場合、その領域における低損失化はより切実である。

またコアとクラッドの屈折率比により、伝搬する光のモードが変化するため、導液路構造を決定するのにそれぞれの屈折率制御は重要である。従来、プラスチック光ファイバはマルチモードが一般的であり、そのため屈折率制御はあまり考慮されず、コア、クラッドに屈折率差の大きいホモポリマを採用している。例えばPMWAをコアとしている。フッ素系のホモポリマをクラッドとしている。これに対しシングルモードを用いる光回路部よの導波路ではより精密で簡易な屈折率制御が求められている。

従来プラスチックで光導波路を形成する方法 は、選択光重合法。感光性樹脂を利用する方法が 知られている。選択光重合法はポリマに含ませた

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は光集積回路用導波路やブラスチック光ファイバなどの導波路として使用可能なブラスチック光導波路に関するものである。

【従来の技術】

ドーパント (アクリル系モノマ) を選択的に重合 あるいはポリマと反応させ、屈折率を変化させる ことによりパターン状の光導波路を作製するもの である。また、感光性樹脂、ホトレジストを利用 する方法は感光性樹脂をパターン状に露光し、選 択的に架構をおこさせ、現像により未露光部分を 除去し、コアパターンを得るものである。

[発明が解決しようとする課題]

両者ともガラス導波路に比べると簡便で手軽に 製造できるが、それぞれ近赤外域で吸収が大きさい ために1.0 μm 以上の長波長の光では使用することはできない。また選択光重合法では溶媒が大きる 条件でモノマ合量が変化し屈折率変化が微妙に発発 化するほか、屈折率比の等の問題がある。また発 化けるにか、屈折率比の等の問題がある。また発 により変化し、また屈折率は照射光量 により解像性が悪く いる。また現像時の影響により解像性が悪く た表面に凸凹ができやすい問題がある。この因と も材料の問題とあわせ両者の光損失が高い原因 なっている。

またポリメチルメタクリレートのように吸湿性が高いポリマは湿度が高い環境では、水のOHの振動吸収が光損失に影響を与える。OH振動吸収の高調波によって、特に近赤外域の光伝送損失は低下する(例えば戒能俊邦、Polymer Preprints、Japan、32巻、4号、1983年 2525頁 参照)すなわち使用環境条件の湿度変化により光伝送損失が変動するといった問題があった。

また有機系ポリマ、特にポリメチルメタクリレート系のガラス転移温度は一般に100 ℃前後である。そのため耐熱温度の上限は70℃程度であり、実用的なものとしては使用不能であった。これらの耐熱性に関する問題を解決するものとして、ゴム状ポリシロキサンを用いた光導波路されてファイバが特開昭62~175703号公報に提案されてファイバが特開昭62~175703号公報に提案されてコム化するために架橋剤を入れるか、放射線による後処理が必要であり、光損失あるいは加工性に問題を持っていた。

【式中、R₁.R₂ はそれぞれC_nY_{2n-1}(Y は水素あるいはハロゲン原子、n は 5 以下の正の整数)で表されるアルキル基あるいはハロゲン化アルキル基、あるいはC_eY₂で表されるフェニルあるいはハロゲン化フェニル基】で表される繰り返し単位を有し、またはそれらの共重合体である。

【作 用】

上述のように従来の材料ではポリメチルメタク リレートがファイバ用材料として提案されている が、屈折率制御、低損失性、吸湿性等に問題を含 んでいる。

本発明における導液路は前記一般式 (I), (II)で示される繰り返し単位を有するポリマを 用いることを本質とする。これらの組合せあるい 本発明はこのような現状に鑑みてなされたものであり、その目的は屈折率制御が容易であり、しかも耐熱性に優れ、また吸湿に伴うOH振動吸収の影響の少ないプラスチック導波路を提供することにある。

[課題を解決するための手段]

本発明は、ポリマからなるコア部と、該コア部を囲みコア部より低い屈折率を有するポリマからなるクラッド部とを有するプラスチック光導液路において、前記コア部およびクラッド部がともにポリシロキサンからなることを特徴とする。

ここでポリシロキサンは下記一般式 I および Ⅱ:

は共重合化により種々の屈折率を持つものが得られ、屈折率制御が容易である。また主鎖精造相がないである。また主鎖精造損化の事故路を得ることができる。さらに側鎖下し、失力ができる。さらに側が大きに低い、のはないができる。PMMA系のポリマが吸湿性が大きいいためによってOH基に基づく吸収強度が大きい、、吸動し、安定した導光特性が得られなかったによい、本発明は極めて安定した光特性を維持しうるという特徴がある。

本発明のポリマは下記一般式 (Ⅲ), (Ⅳ)

[式中、R₁、R₂ は一般式(I)、(Ⅱ)中のものと等しい]で表わされるクロロシランの加水分解

で得られるシラノールや環状ポリシロキサンの単独重合あるいは共重合により得ることができる。また一般式(III)、(IV)で表されるクロロシランとアルコールを反応して得られる各種のアルコキシシランの重合やハロゲノシランとアルコキシシランの縮重合によってもポリマを得ることができる。なおnが6以上ではポリマのガラス転移温度が低くなるため、取扱いに問題があり、nが5以下が望ましい。

本発明におけるポリマの製造法は、一般のポリシロキサン製造法と同様であり、クロロシランをエーテル等に溶解し加水分解後、トルエン、キシレン等の有機溶媒に溶解しKOH 等のアルカリで重合を行わせるものである。

[実施例]

以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

粉末、8gの CuC e、0.25g の ZnC e 。をよく混合して充填した。窒素気流中430 ℃に加熱し CuC e を還元した。冷却後、40g のモノクロロベンゼンをいれ、430 ℃で15時間反応させると約20g のクロロシランが得られた。これを蒸留塔で蒸留し、184 ~186 ℃ (30mmHg)の留分のジフェニルジクロロシラン13g を得た。

モノマ 製造例3

ジメチルジクロロシランの合成

管状電気炉の石英製反応管に 45g の Si粉末、8g の CuC & 、0.25g の ZnC & 、をよく混合して充填した。窒素気流中 300 ℃に加熱し CuC & を還元した。さらに温度を 320 ℃に保ち、クロロメタンを 0.8 & /hr の割合で反応管に流すと、15時間で約 20g のクロロシランが得られた。これを精留塔で精留し、69~70℃の留分のジメチルジクロロシラン12g を得た。

モノマ製造例1

フェニルトリクロロシランの合成

- ① 1 ℓのステンレス製オートクレーブに244gの HSiCℓ。, 140gのCeHe. 触媒としてBCℓ。を 仕込み、270 ℃で最大圧力65kg/cm²で10時間 反応させた。冷却後340gの生成液を得た。常 圧蒸留で200 ~201 ℃の留分の CeHeSiCℓ。 130gを得た。
- ② 500m e のフラスコに 37.4g の SiC e 。を 200m e のヘブタンに溶かしたものを入れた。次に滴下ロートからフェニルマグネシウムクロライドのテトラヒドロフラン溶液を 500m e / hの割合で滴下し、撹拌しつつ温度は 40~50℃に保った。滴下後 2 時間 還流し、沈殿は 5 過した。 建液を蒸留し常圧蒸留で 200~201℃の留分の C e H e SiC e 。 20g を得た。

モノマ製造例2

ジフェニルジクロロシランの合成

10のステンレス製オートクレーブに45g のSi

モノマ製造例4

メチルトリクロロシランの合成

管状電気炉の石英製反応管に45gのSi粉末、8gの CuC 4,0.25gの ZnC 4,をよく混合して充填した。窒素気流中300 ℃に加熱し CuC 4を還元した。さらに温度を320 ℃に保ち、クロロメタンを0.4 4/hr の割合で反応管に流すと、15時間で約20gのクロロシランが得られた。これを精留塔で精留し、64~65℃の留分のメチルトリクロロシラン14gを得た。

モノマ製造例 5

ペンチルトリクロロシランの合成

モノマ製造例 4 でクロロメタンの代わりにクロロペンタンとすることにより沸点 166 ~168 ℃のペンチルトリクロロシラン10g を得た。

モノマ製造例 6

フェニルメチルジクロロシランの合成

還流冷却器、温度計、ガス吹き込み管を備え

モノマ製造例7

ブロムフェニルトリクロロシランの合成

塩化カルシウム管、温度計、滴下ロートを備えた200m & のフラスコに、四塩化炭素100m & 、モノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロルシラン20g 、鉄触媒 0.2gを入れ、冷浴で冷却しつつ臭素5.3gを滴下した。10時間反応させ、得られた反応液を蒸留し120~125 ℃ (15mmHg)の留分15g を得た。

た 200m ℓ のフラスコに、四塩化炭素 100m ℓ、モノマ製造例 1 で得られたジメチルジクロルシラン 20g 、塩化第二鉄 0.3g、沃素 0.1gを入れ、50g の塩素ガスを吹き込む。得られた反応液を蒸留しクロロメチルメチルジクロロシラン12g を得た。

モノマ製造例11

ピスクロロフェニルジクロロシランの合成

塩化カルシウム管、温度計、滴下ロートを備えた200m & のフラスコに、四塩化炭素100m & 、モノマ製造例 2 に得られたジフェニルジクロロシラン30g 、塩化第二鉄0.3g、沃素0.1gを入れ、50g の塩素ガスを吹き込む。得られた反応液を蒸留し175 ~179 ℃ (7mmHg) の留分13g を得た。

ポリマ製造例1

内容約 50m e のフラスコにモノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロルシラン10g をエチルエーテル 20m e に溶かし水100m e の中にそそぎ込み加水分解を行った。次に加水分解物を分離し

モノマ製造例8

クロロフェニルトリクロロシランの合成

塩化カルシウム管、温度計、滴下ロートを備えた200m & のフラスコに、四塩化炭素100m & 、モノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロルシラン20g ,塩化第二鉄0.3g,沃素0.1gを入れ、50g の塩素ガスを吹き込む。得られた反応液を蒸留し87~88℃ (7amHg) の留分18g を得た。

モノマ製造例9

フルオロフェニルトリクロロシランの合成

モノマ製造例10

クロロメチルメチルジクロロシランの合成 塩化カルシウム管、温度計、滴下ロートを備え

100mg の KOH を添加し、 15m ℓ のトルエンと混合した。そして、この混合液を16時間遠流した。反応終了後冷却し、少量の沈殿量をろ適した後、メタノールに溶液を流し込むことにより再沈設を行った。得られたポリフェニルシルセスキオシンの分子量は M ** = 15000 , M ** / Mn = 2.1 であった。赤外線吸収スペクトルによりシルセスキオキサン特有の Si-0に起因する ダブルピークが 1040 cm⁻¹ および 1160 cm⁻¹に見られた。このポリマの屈折率は 1.5549(入=0.633)であった。またこのポリマは高い耐熱性を示し、300 でで 1 時間熱処理してもなんらの変化がみられかなった。

ポリマ製造例2

モノマ製造例 2 で得られたジフェニルジクロロシランを水と反応させることにより得たジフェニルシランジオール 30g をクロロホルム 500m & に溶かし、CF * SO * H を触媒として、5 ℃で 20時間反応させた。反応液をメタノール中にそそぎ込み白色固体のポリマを得た。このポリマの屈折率

は1.6143(ル=0.633)、分子量はMw=5000, Mw/Mn =1.6 であった。

ポリマ製造例3

トリクロロフェニルシランとジフェニルクロロシランの仕込比を変えて、製造例1と同様にして 共重合体を合成した。表1に組成比と屈折率の関係を示す。

表 1 モノマ仕込比と屈折率の関係

仕込比(トリ体/ジ体)	屈折率
100/ 0	1.5549
90/ 10	1.5675
80/ 20	1.5752
0/100	1.6143

ポリマ製造例4

モノマ製造例 3 で得られたシメチルシクロロシラン10g をエチルエーテル 20m & に溶かし水100m & の中にそそぎ込み加水分解を行った。次に加水分解物を分離し100mg の KOH を添加し、

ロロシラン10g をエチルエーテル 20m & に溶かし水100m & の中にそそぎ込み加水分解を行った。次に加水分解物を分離し100mg の KOH を添加し、15 m & のトルエンと混合した。以下ポリマ製造例1 と同様の処理を行い、ポリマを得た。得られたポリマの分子量 Hw = 53000、Mw/Mn = 2.8 であった。このポリマの屈折率は1.5132であった。

ポリマ製造例で

モノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロルシラン 5 gとモノマ製造例 5 で得られたペンチルトリクロロシラン 4.5 g、エチルエーテル 20 m 2 に溶かし水 100 m 2 の中に そそぎ込み 加水分解を行った。次に加水分解物を分離し100 m g の KOH を添加し、 15 m 2 のトルエンと混合した。そして、この混合液を 1 6時間 還流した。 反応終了後 かし、小量の沈殿物をろ過した後、メタノールに溶液を流し込むことにより再沈殿を行った。 得られたポリマの分子量 M m = 21000 であった。

15 m ℓ のトルエンと混合した。以下ポリマ製造例 1 と同様の処理を行い、ポリマを得た。得られたポリマの分子量は Mw=18000、Mw/Mn=2.5 であった。

ポリマ製造例5

内容約 50m e のフラスコにモノマ製造例 4 で得られたメチルトリクロルシラン10g をエチルエーテル 20m e に溶かし水100m e の中にそそぎ込み加水分解を行った。次に加水分解物を分離し100mg の KOH を添加し、 15m e のトルエンと混合した。そして、この混合液を16時間還流した。反応終了後冷却し、少量の沈殿物をろ過した後、メタノールに溶液を流し込むことにより再沈殿を行った。得られたポリメチルシルセスキオキサンの分子量はMw = 2000、Mw/Mn = 3.1 であった。またこのポリマの屈折率は1.4231であった。

ポリマ製造例6

モノマ製造例6で得られたフェニルメチルジク

ポリマ製造例8

モノマ製造例 1 で得られたフェニルトリクロルシラン10g とモノマ製造例 3 で得られたジメチルジクロロシラン2gをエチルエーテル 20m ℓ に溶かし水100m ℓ の中にそそぎ込み加水分解を行った。次に加水分解物を分離し100mg の KOH を添加し、15 m ℓ のトルエンと混合した。そして、この混合液を16時間退流した。反応終了後冷却し、小量の沈殿物をろ過した後、メタノールに溶液を流し込むことにより再沈殿を行った。得られたポリマの分子量 Mw = 16000 であった。

同様な方法によりモノマ製造例にあげたモノマ を用いて重合体を得ることができた。

実施例1

ポリマ製造例 1 で得たポリマを板状に加工 し、両面を光学研磨し分光器で近赤外~可視光域 での吸収を測定した。その結果660、850、1300、 および1550nmにおけるオプティカルデンシティ

特開平4-157402(8)

(0D) はそれぞれ 0.012、 0.010、 0.012 および 0.024(cm⁻¹) であり、きわめて高い透光性を示した。同様にして他のポリマについても吸収を測定した。表 2 にその結果をまとめた。

表2 製造したポリマの透光性

化学構造		特定波長におけるOD				
主鎖構造*	R.	R ₂	660	850	1300	1550nm
П	CH.	CH.	0.012	0.008	0.010	0.020
п	C _e H ₄ Br	CeH4Br	0.019	0.009	0.016	0. 036
п	C.H.C.€	C.H.C.e	0.019	0.009	0.018	0.039
П	C₀H₄F	C _e H _e F	0.010	0.008	0.018	0.032
п	C _e H _e	CsH 1 1	0.016	0.010	0.028	0.110
1	CaHs	CaHe	0.012	0.028	0.035	0.085
I	C ₆ H ₉	CH ₂	0.013	0.012	0.024	0.065
ı	CH ₃	CH. C.e	0.006	0.002	0.022	0. 032
ı	CH.	CH ₃	0.008	0.005	0.023	0.045
I	C ₆ H₄C &	C₀H₄C &	0.012	0.008	0.017	0.041
v	CaHs	CH*	0.004	0.005	0. 002	0.009

に溶かし溶液とした。まずクラッド成分ポリマをシリコン基板上に約20μmの厚さに塗布した。ペーク、乾燥処理後クラッド成分ポリマ上にコア成分ポリマを約8μmの厚さに塗布した。次にホトリソグラフィ、ドライエッチングによりコア成分ポリマを長さ50mm、幅8μm。高さ8μmの直線矩形パタンに加工した。加工後クラッド成分をコア成分ポリマ上に塗布し導液路を得た。波見1300nm、1500nmの光を導液路の一端から照射し、他端から出てくる光量を測定することが取り、1500nmの光を導液路の損失は0.5dB/cm以下であり充分に種々の光回路に供することができる。

実施例3

ポリマ製造例 3 で得たトリ体/ジ体 = 80/20 の 共重合体をコア成分、トリ体/ジ体 = 90/10 の 共重合体をクラッド成分とする導液路を作製し た。

前述の2種のポリマをメチルイソブチルケトン

主鎖構造

爽施例 2

ポリマ製造例1で得たポリマをコア成分、ポリマ製造例5で得たポリマをクラッド成分とする導

波路を作製した。

前述の2種のポリマをメチルイソプチルケトン

に溶かし溶液とした。まずクラッド成分ポリマをシリコン基板上に約20μmの厚さに塗布した。ベク,乾燥処理後クラッド成分ポリマ上にコア成分ポリマを約8μmの厚さに塗布した。次にホホ分パリマを長さ50mm、幅8μm。高さ8μmの頂線セルタンに加工した。加工後クラッド成分を見1300mm、1500mmの光を導液路の一端から照射し、他路の大量を削定することにより導液路の損失を計算した。この導液路の損失は0.5dB/cm以下であり充分に種々の光回路に供することができる。

実施例4

実施例3の光導波路を60℃、90% RHの条件下で2昼夜静置してから取り出し、光損失を測定した。吸湿に基づく損失増は全くなく、耐湿性の高いことが確認された。

[発明の効果]

以上説明したように、本発明によるブラスチック導波路は、従来のものにくらべ、屈折率的が容易である。また、可視~近赤外光域におり湿かない。高温多ないで、高温多ないので、高温を増かいるので、多成分系がラスないにおいるので、多成分系がラスないにで、多成分系がラスないにで、多成分系がラスないにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりにで、多成分系がラスなりに、というなどので、多成分系がある。できる利点がある。

特許出願人 日本電信電話株式会社

代理人 弁理士谷 義一

THIS PAGE BLANK (USPRO)